

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора ИХВВ РАН

Буланов А.Д.

“13” февраля 2018 г.



**Перечень основного оборудования центра коллективного пользования
“Анализ, сертификация, мониторинг высокочистых веществ и
материалов на их основе”**

- Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой «ELEMENT-2; «Thermo Scientific», Германия.
- Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой iCAP-6300 Duo Thermo Electron Corporation», США.
- Атомно-абсорбционный спектрометр «Perkin-Elmer 5100PC».
- Атомно-абсорбционный спектрометр «AAS-3» Carl Zeiss Jena.
- Атомно-эмиссионный спектрометр с дуговой плазмой «Labtam».
- Система подготовки проб к анализу с микроволновым нагревом «MDS б».
- ИК-Фурье-спектрометр «Bruker IFS-125HR».
- ИК-Фурье-спектрометр «IRprestige-21», Shimadzu.
- ИК-Фурье-спектрометр «Tensor 27», Bruker.
- ИК-Фурье-спектрометр «Nicolet-6700».
- ИК-Фурье спектрометр «IFS-113v», Bruker
- Рентгено-флуоресцентный спектрометр «Optim’X».
- Сканирующий электронный микроскоп «SEM-515».
- Оптический микроскоп «AxioPlan-2».
- Оптический микроскоп «Axio Imager M2», Carl Zeiss.

- ИК-микроскоп «Hyperion».
- Дифференциальный сканирующий блок (калориметр) «DSC 404 F1 Pegasus».
- Синхронный термоанализатор «STA-409 PC LUXX».
- Хромато-масс-спектрометр «Agilent 6890/5973N».
- Хроматографический комплекс «Кристаллюкс 4000М».
- Газовый хроматограф «Цвет-500», «Цвет-800».
- Микроволновая система для пробоподготовки «MDS-6 Sineo», КНР.
- Установка получения деионизированной воды.
- Лазерный масс-спектрометр «ЭМАЛ-2».
- Спектрограф дифракционный со скрещенной дисперсией «СТЭ-1».
- Газовый хроматограф «Кристалл 4000М».
- Хроматограф жидкостный, ионный «Цвет-3006».
- Весы электронные лабораторные «AW 220», Shimadzu.
- Весы электронные лабораторные «A200», Sartorius.
- Газостатическая установка «УГЛ-200».
- Модуль «SAA-800» и «SAA-20» для установки осаждения моноизотопных разновидностей кремния.
- Станки для тонкого шлифования, полирования и доводки плоских и сферических поверхностей «3ПД-320», «4ПД-200», «ПД-500».
- Сферошлифовальный станок «АШС – 70».
- гониометр «Г5».
- сферометр «ИЗС-7».
- Камерная печь «СНОЛ 6/12».
- Автоматизированный стенд для измерения электрофизических параметров эпитаксиальных слоев.

- Камерная электропечь сопротивления «Термокерамика» ТК.4-1250.L.1Ф».
- Высокопроизводительный вычислительный комплекс в составе 2-х серверов и 2-х рабочих станций.
- Горячий пресс «ГП-60».
- Установка для бестигельной зонной плавки «FZ350-15».
- Установка для изготовления поликристаллического CVD–ZnSe и CVD–ZnS.
- Установка для глубокой очистки моноизотопных гидридов кремния и германия.
- Установка для кристаллизационной очистки и выращивания поли- и монокристаллов элементарных полупроводников.
- Установка для MOCVD выращивания эпитаксиальных слоев твердых растворов CdHgTe.
- Установки для изготовления специальных световодов из кварцевых и неоксидных стекол.
- Комплекс научно-технологического оборудования по изготовлению CVD-методом крупногабаритных оптических элементов из поликристаллического селенида и сульфида цинка.
- Анализаторы «P102 York Technology» и «2600 Photon Kinetics» для измерения профиля показателя преломления в преформах.
- Экспериментальная установка для измерения интенсивности люминесценции в преформах.
- Установка для измерения оптических потерь в световодах (диапазон длин волн 600-1700 нм).
- Спектроанализатор «HP 70952 B» для измерения оптических потерь в световодах.
- Рефлектометр «Yokogawa AQ7932» для измерения оптических потерь в световодах.

- Спектроанализатор «Ocean Optics HR4000» (диапазон длин волн 200-1100 нм).
- Измеритель мощности излучения «OPHIR NOVA II» с измерительной головкой (до 3 Вт).